逆畳み込み・畳み込み計算による粉末回折データ処理

Powder Diffraction Data Processing by Deconvolution-Convolution Calculation

名古屋工業大学・先進セラミックス研究センター 井田 隆

Takashi Ida, Advanced Ceramics Research Center, Nagoya Inst. Tech.

Introduction

実測の粉末回折ピーク形状(20-1 図形)は**試料固有の本質** 的な回折ピーク形状とX線源の分光強度分布,装置ぼやけ・ 収差との畳み込みで表現できると理解されてきた。

正しくは、X線源の分光強度分布の影響は対数正弦スケール (ln sin θ) で畳み込みとして表現される。それを前提とすれ ば**逆畳み込み**計算により分光強度分布由来の偽ピークを除去 するのは容易である。

Bragg-Brentano ジオメトリの装置収差のうち,平板試料収差 は対数正割スケール ($\ln \sec \theta$),試料透過性収差は対数正接 スケール ($\ln \tan \theta$) で畳み込みとして表現される。最も目立 つ軸発散収差の影響は複雑だが,近似的に二重のスケール変 換・畳み込みで表現される。

Method

スケール変換・逆畳み込み・畳み込み処理:

$$\eta(\xi) \leftarrow \int_{-\infty}^{\infty} I(2\theta) \frac{\mathrm{d}2\theta}{\mathrm{d}f(2\theta)} \mathrm{e}^{2\pi \mathrm{i}\xi f(2\theta)} \mathrm{d}f(2\theta)$$
$$I'(2\theta) \leftarrow \frac{\mathrm{d}f(2\theta)}{\mathrm{d}2\theta} \int_{-\infty}^{\infty} \eta(\xi) \frac{\gamma_2(\xi)}{\gamma_1(\xi)} \mathrm{e}^{-2\pi \mathrm{i}\xi f(2\theta)} \mathrm{d}\xi$$

スケール変換関数を $f(2\theta)$ とする。

分光形状処理では、 $\gamma_1(\xi)$ を現実的な分光強度図形、 $\gamma_2(\xi)$ を仮想的な単一ピーク図形の $f(2\theta)$ スケール上での Fourier 変換とする。

収差処理では、 $\gamma_1(\xi)$ を収差関数の $f(2\theta)$ スケール上での Fourier 変換、 $\gamma_2(\xi)$ を $\gamma_1(\xi)$ の複素絶対値とする。



Fig.1 逆畳み込み・畳み込み処理による粉末回折強度図形の変化。 装置収差によるピークシフトと非対称な変形が修整され、偽ピークが除去される(ように見える)。

参考文献

T. Ida et al., Powder Diffr. 33, 80–87 (2018a); T. Ida et al., Powder Diffr. 33, 108–114 (2018b); T. Ida et al., Powder Diffr. 33, 121–133 (2018c).